産研サブピコ秒パルスラジオリシス装置の現状

古澤 孝弘^{1,A)}、佐伯昭紀^{B)}、岡本一将^{B)}、竹谷孝司^{A)}、 山本保^{A)}、末峰昌二^{A)}、吉田陽一^{A)}、田川精一^{A,B)}

 ^{A)} 大阪大学産業科学研究所産業科学ナノテクノロジーセンター 〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1
^{B)} 大阪大学産業科学研究所量子ビーム科学分野 〒567-0047 大阪府茨木市美穂ヶ丘 8-1

概要

フェムト秒電子線とフェムト秒レーザーを組み合わせたサプピコ秒パルスラジオリシス装置は放射線によって物質中に誘起される放射線化学反応を解明するための非常に強力な測定手段であるが、同時に、 放射線照射直後のナノ空間内反応を解明するための 有効な手段である。本報告では、阪大産研サプピコ 秒パルスラジオリシス装置の現状とナノ加工用材料 反応解析への適用例を報告する。

1.序

放射線と物質との相互作用及びその結果引き起こ される現象に関しては、放射線の生体影響及び工業 利用、原子力発電等の観点から莫大な量の研究が行 われてきた。近年、イオンビームによるガン治療の 本格化、電子線・X線リソグラフィに代表される放 射線源の半導体製造工程への大規模な導入の可能性、 アメリカが中心となって進めている宇宙ステーショ ンや火星への有人飛行計画に代表される人類の宇宙 への進出等、今後放射線と物質との相互作用の理解 はますます重要になると考えられる。DRAM に代表 されるマイクロエレクロトニクス素子の出現は、人 類に高度情報化社会への道を開いたが、歴史的にマ イクロエレクトロニクスはリソグラフィと呼ばれる 微細加工技術の改良に大きく依存しながら発展して きた。例えば、微細化において重要な露光源は、水 銀灯(G線、I線)や KrF エキシマレーザーが大量 生産に使用されており、現在、ArF エキシマレーザ ーが生産ラインに投入されようとしている。さらに、 次期露光源としてF2エキシマレーザーの研究開発が 進められている。しかし、最小加工線幅の縮小に伴 い、近い将来、光リソグラフィの解像度は市場の二 ーズを満たせなくなると考えられ、電子線やX線の ような放射線が光に代わる露光源として期待されて いる。また、近年ナノテクノロジーが生命科学や情 報科学など様々な分野で注目を集めているが、電子 線、X線リソグラフィはナノ構造物の大量生産のた めの有力な加工ツールの一つとして期待され、レジ ストや光学系、マスク等の要素開発が進められてい

る。特にレジストは大量生産のための最重要要素技 術であり、精力的な研究が進められている。高性能 レジストを開発し、あるいは感度や解像度といった レジスト性能を効率的に改良するためには、パター ン形成時にレジスト内に放射線によって誘起される 反応を理解することが重要である。

レジストに放射線が入射すると、ベース樹脂がイ オン化され、ベース樹脂のカチオンラジカルと電子 が生成し、電子は周りの分子との相互作用によりエ ネルギーを失い熱化する。熱化電子の平均初期分布 距離は物質によるが約数 nm あると考えられている。 電子線・X 線用化学増幅型レジストでは最初のイオ ン化で生成したカチオンラジカルと電子の両者が酸 の生成に重要な役割を果たしている^[1-4]。そのため、 ナノメーターオーダーの加工、あるいは、ナノメー ターオーダーのラインエッジラフネスを要求される 加工においては、熱化電子の初期分布距離は潜像の 形成において、重要な意味を持ち、イオン化後の熱 化電子のマトリクス内での拡散はレジストの空間分 解能の劣化を引き起こすと考えられる。そのため、 熱化直後の時間領域でのレジスト内での放射線化学 反応はナノ加工用材料にとって非常に重要な意味を 持つと考えられる。本報告では、阪大産研サブピコ 秒パルスラジオリシス装置の現状とナノ加工用材料 反応解析への適用例を報告する。

2.サプピコ秒パルスラジオリシスシステ ム

サブピコ秒パルスラジオリシスシステム(図1)は、 励起源としてのフェムト秒電子線ライナック^[5]、分析 光源としてのフェムト秒手タンサファイアレーザー ^[6]、また、両者の時間差を正確に測定するためのフェ ムト秒ストリークカメラから構成される^[7,8]。フェム ト秒電子線は、阪大産研Lバンドライナックからの 電子線シングルパルスを磁気パルス圧縮法によって 圧縮することにより得た^[6]。チタンサファイアレーザ ーとライナックは27MHzを基準信号とする共通のR Fで同期がとられている。また、両者の時間差を正 確に知るために、ポート出口からサンプル直前の薄 ミラーまでの空気中で発生するチェレンコフ光を、 分析光からハーフミラーで分岐したレーザーパルス

¹⁾E-mail: kozawa@sanken.osaka-u.ac.jp



図1.阪大産研サブピコ秒パルスラジオリシスシステム

と合流させ、ストリークカメラに入射させることに より両者の時間差を各ショット毎に測定した。この システムにより時間ジッターの影響をストリークカ メラの時間分解能までに低減することが可能である。 フェムト秒電子線、フェムト秒レーザーのパルス幅 はそれぞれ最短 125 fs(FWHM)、60 fs(FWHM)であり、 ストリークカメラの時間分解能は 185 fs(FWHM)で ある。

さらに吸収分光の S/N 比を改善するためダブルパ ルス法を考案し、ショット毎の信号の揺らぎを 0.8% にまで低減して実験を行っている^[8]。

3.ナノリソグラフィ材料研究への適用

高分子材料のモデル化合物として n-ドデカンを用 い、サブピコ秒パルスラジオリシス実験を行った。 得られた時間プロファイルを図2に示す。この図は n-ドデカンのカチオンラジカルの時間挙動を示して いる。イオン化によりカチオンラジカルと電子が生 成した後、お互いの電場で引き寄せられて再結合で 消えて行く過程を見ている。このような中間活性種 の時間挙動を測定することにより、熱化電子の初期 分布及びその後に続く電子の空間分布の変化をシミ ュレーションにより求めることが可能である^[9-10]。 n-ドデカンのカチオンラジカルの時間挙動から再構 成された n-ドデカン中での熱化電子の初期分布とそ れに続く分布の変化を図3に示す。n-ドデカン中では 熱化電子の初期分布距離は 6.6 nm である。化学増幅 型レジストでは最初のイオン化で生成したカチオン ラジカルと電子の両者が酸の生成に重要な役割を果 たしている。そのため、ナノメーターオーダーの加 工、あるいは、ナノメーターオーダーのラインエッ ジラフネスを要求される加工においては、熱化電子 の平均初期分布距離は潜像の形成において、重要な 意味を持ち、イオン化後の熱化電子のマトリクス内 での拡散はレジストの空間分解能の劣化を引き起こ すと考えられる。そのため、熱化直後の電子とオニ ウム塩の反応をメタノールのパルスラジオリシスに より調べた。メタノール中に生成される中間活性種 の時間挙動を図4に示す。メタノール中では電子が







Distance between the cation radical and the electron (nm)

図3.n-ドデカン中での熱化電子の分布の変化

熱化した後溶媒和前電子、次いで、溶媒和電子が生 成されることが報告されており、波長 790 nm では両 者が観測される。二状態モデルを仮定し、次式でフ ィッティングした結果を同図に示した。

$$f_{0}(t) = \frac{A_{0}\tau_{1}}{\tau_{0} - \tau_{1}} \left(e^{-\frac{t}{\tau_{0}}} - e^{-\frac{t}{\tau_{1}}} \right)$$
$$f_{1}(t) = A_{1} \left(1 - \frac{\tau_{0}e^{-\frac{t}{\tau_{0}}} - \tau_{1}e^{-\frac{t}{\tau_{1}}}}{\tau_{0} - \tau_{1}} \right)$$

ここで、f₀(t)、f₁(t)はそれぞれ溶媒和前電子、溶媒 和電子の時間挙動、t0、t1 は溶媒和前電子、溶媒和 電子の生成時間、A₀、A₁は定数である。図5に200 mM トリフェニルスルフォニウム-メタノール溶液でのパ ルスラジオリシスの結果を示す。この結果から、数 ピコ秒以内の時間で、オニウム塩が溶媒和前電子の 生成過程と熱化電子を競合的に取り合っていること がわかる。このようなオニウム塩と電子の効率的な 反応は、カチオン種の収量の増加という役割だけで なく、熱化電子の拡散による空間分解能の劣化を抑 えるという役割も同時に果たしていると考えられる。 しかしながら、電子の平均熱化距離は約数ナノメー ターあると推定されるので、今後のナノリソグラフ ィ用レジストの開発においては、考慮すべき問題点 となると考えられる。

参考文献

- T. Kozawa, S. Nagahara, Y. Yoshida, S. Tagawa, T. Watanabe and Y. Yamashita, J. Vac. Sci. Technol. B15 (1997) 2582-2586.
- [2] S. Nagahara, T. Kozawa, Y. Yamamoto and S. Tagawa, J. Photopolym. Sci. Technol. 11 (1998) 577-580.
- [3] S. Tsuji, T. Kozawa, Y. Yamamoto, S. Tagawa, Sci. Technol. 13 (2000) 733-738.
- [4] S. Tagawa, S. Nagahara, T. Iwamoto, M. Wakita, T. Kozawa, Y. Yamamoto, D. Werst and A. D. Trifunac: Proc. SPIE, California, 2000 p.204.
- [5] T. Kozawa, Y. Mizutani, K. Yokoyama, S. Okuda, Y. Yoshida and S. Tagawa, Nucl. Instrum. Meth. A429 (1999) 471-475.
- [6] Y. Yoshida, Y. Mizutani, T. Kozawa, A. Saeki, S. Seki, S. Tagawa and K. Ushida, Radit. Phys. Chem. 60 (2001) 313-318.
- [7] T. Kozawa, Y. Mizutani, M. Miki, T. Yamamoto, S. Suemine, Y. Yoshida and S. Tagawa, Nucl. Instrum. Meth. A440 (2000) 251-254.
- [8] T. Kozawa, A. Saeki, Y. Yoshida and S. Tagawa, Jpn. J. Appl. Phys. (2002) in press.
- [9] A. Saeki, T. Kozawa, Y. Yoshida and S. Tagawa, Radit. Phys. Chem. 60 (2001) 319-322.
- [10] A. Saeki, T. Kozawa, Y. Yoshida and S. Tagawa, Jpn. J. Appl. Phys. (2002) in press.



図4.サブピコ秒パルスラジオリシスにより得られた メタノール中での溶媒和前電子及び溶媒和電子の時 間挙動(波長 790 nm)



図 5 . 200mM 酸発生剤 (トリフェニルスルフォニウ ム)メタノール溶液中における中間活性種の挙動(波 長 790 nm)